



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 866583

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 14.01.80 (21) 2868927/18-21

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.09.81. Бюллетень № 35

Дата опубликования описания 03.10.81

(51) М. Кл.

Н 01 С 17/00,
Н 05 К 13/08

(53) УДК 621.315.
.684 (088.8)

(72) Авторы
изобретения

В.А.Сокол, О.С.Катернога, и А.С.Карабун

(71) Заявитель

Минский радиотехнический институт

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИКРОСХЕМ

1

Изобретение относится к технологическому оборудованию электронной промышленности и предназначено для зондового контроля электрических параметров результатов и конденсаторов микросхем.

Известно устройство для зондовых измерений неразрезанной подложке динамических параметров интегральных схем, содержащая оптическую систему, предметный столик, механизм крепления зондовых и маркировочных головок, механизм шаговых перемещений и манипулятор.

Оптическая система устройства представляет собой стереоскопический микроскоп, используемый для визуального контроля установки токопроводящих зондовых головок на контактные площадки микросхем. Для зондовых измерений к устройству подключен автоматический прибор контроля динамических параметров интегральной схемы [1].

5

Недостатком этого устройства является невозможность использовать его в производственном цикле, для контроля отдельных плат интегральных схем и для контроля гибридных интегральных схем с дискретными пассивными и активными компонентами.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является устройство для контроля и подготовки величины сопротивления тонкопленочных резисторов, содержащее стереоскопический микроскоп, предметный столик, зондовую головку с одной парой зондов и контрольно-измерительный прибор.

Контрольно-измерительный прибор этого устройства представляет собой цифровой вольтметр, при помощи индикатора которого визуально считаются величины сопротивлений. Стереоскопический микроскоп использован для визуального контроля установки зондов и для микростереоскопических исследований [2].

2

Недостатком известного устройства является то, что затруднено наблюдение микросхемы через микроскоп и одновременный визуальный контроль величины сопротивления контролируемого резистора этой микросхемы по индикатору контрольно-измерительного прибора, так как индикатор и окуляры микроскопа не находятся в поле зрения одновременно, что не обеспечивает необходимых эксплуатационных удобств.

Цель изобретения - повышение производительности.

Эта цель достигается тем, что устройство для контроля микросхем, содержащее зондовую головку, стереоскопический микроскоп, предметный столик и контрольно-измерительный прибор с индикатором, снабжено проекционным и поворотным зеркалами и линзовой системой, причем проекционное зеркало размещено под углом в поле зрения микроскопа, а поворотное зеркало - на оптической оси проекционного зеркала, линзовой системы и индикатора контрольно-измерительного прибора.

На фиг. 1 изображена схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - изображение в поле зрения микроскопа.

Устройство для контроля микросхем содержит последовательно установленные и оптически связанные стереоскопический микроскоп 1, проекционное зеркало 2, поворотное зеркало 3, линзовую систему 4, а также контрольно-измерительный прибор с индикатором 5, помещенным в поле зрения линзовой системы 4, и предметный столик 6 с зондовой головкой 7, на котором крепится контролируемая микросхема 8.

Микроскоп 1 состоит из штатива с головкой, скачкообразного переключателя увеличения, бинокулярной стереоскопической насадки и осветителя. Зондовая головка 7 состоит из двух токопроводящих зондов, выполненных в виде игольчатых щупов.

Проекционное зеркало 2 находится под объективом микроскопа 1, занимает часть поля зрения микроскопа и расположено под углом к плоскости объектива.

Поворотное зеркало 3 установлено на оптической оси проекционного зеркала 2, а линзовая система 4 расположена на одной оптической оси с поворотным зеркалом 3 и индикатором 5.

Вследствие переотражений от поворотного 3 и проекционного 2 зеркал

изображение индикатора 5 попадает в поле зрения микроскопа 1. Одновременно в поле зрения микроскопа 1 находится предметный столик 6 с зондовой головкой 7, на котором расположена микросхема 8. Причем контрольно-измерительный прибор электрически соединен с зондовой головкой 7.

Устройство работает следующим образом.

Контролируемую микросхему 8 кладут на предметный столик 6. Устанавливают увеличение объектива микроскопа 1 и фокусируют его на микросхему. Затем при помощи регулирования положения отражающей поверхности проекционного 2 и поворотного 3 зеркал и линзовой системы 4 вводят в поле зрения микроскопа 1 изображение индикатора 5 контрольно-измерительного прибора 5. Для этого линзовой системой 4 проектируют резкое изображение индикатора 5 контрольно-измерительного прибора на плоскость поворотного зеркала 3. Затем выполняют ввод спроектированного на плоскость поворотного зеркала 3 изображения в плоскость проекционного зеркала 2, для чего измеряют угол поворота плоскости поворотного зеркала 3. Проекционным зеркалом 2 определяют площадь зоны наблюдения индикатора 5, для чего изменяют угол поворота зеркала 2. После ввода изображения индикатора 5 в поле зрения микроскопа начинают контролировать электрические параметры элементов микросхемы с помощью зондовой головки 7. При этом в поле зрения микроскопа одновременно находятся изображения зондов на контактных площадках микросхемы и индикатора 5 контрольно-измерительного прибора с информацией о электрическом параметре контролируемого элемента микросхемы.

Расположение проекционного зеркала под объективом микроскопа не мешает качественно проводить микростереоскопическое исследование и контроль микросхемы, а возможность одновременного наблюдения в поле зрения микроскопа контролируемой микросхемы с установленными зондами и изображениями индикатора повышает удобство обслуживания и производительность работы оператора.

Формула изобретения

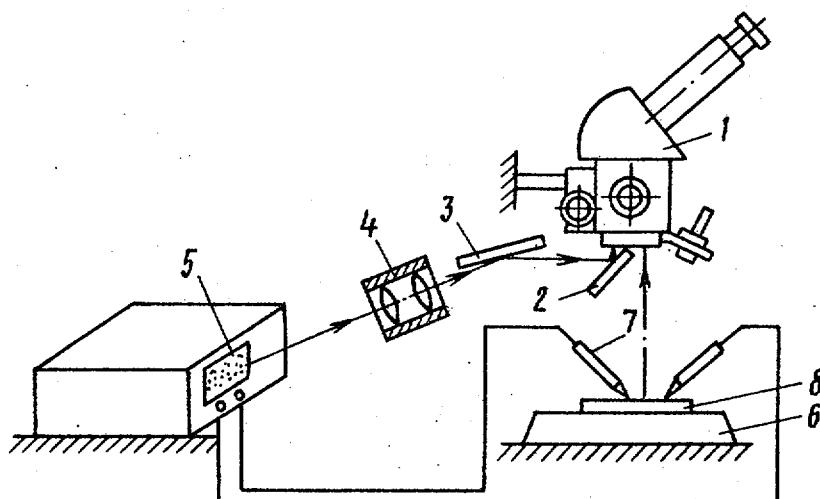
Устройство для контроля микросхем содержащее зондовую головку, стерео-

скопический микроскоп, предметный столик и контрольно-измерительный прибор с индикатором, отличающиеся тем, что, с целью повышения производительности, оно снабжено проекционным и поворотным зеркалами и линзовой системой, причем проекционное зеркало размещено под углом в поле зрения микроскопа, а поворотное зеркало - на оптической оси проекцион-

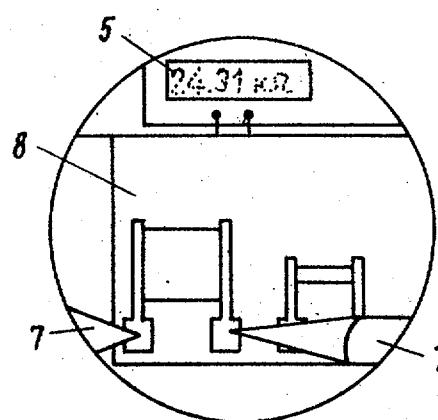
ного зеркала, линзовой системы и индикатора контрольно-измерительного прибора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 274232, кл. Н 01L 21/66, 1969.
2. "Электроника", 1967, № 23, 10 с. 86 (прототип).



Фиг. 1



Фиг. 2

Составитель Л. Проқопенко

Редактор О. Черниченко

Техред И. Асталаш

Корректор М. Шарови

Заказ 8084/72

Тираж 787

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4